

2017年6月吉日

ご来場社各位

英和株式会社

第21回 機械要素技術展／ご来場の御礼

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、6月21日（水）～23日（金）に開催されました第21回機械要素技術展にて、ご多忙中にも関わらず弊社ブースにお越し頂き誠に有難うございました。おかげをもちまして、展示会開催期間中多数のご来場者様にご高配賜わり、盛況のうちに展示会を終了することができましたこと厚く御礼申し上げます。

また、弊社は仏国 SIC MARKING 社製のワークステーション型ファイバーレーザーマーカ：L-Box をはじめとする刻印機及びオリンパス株式会社製蛍光 X 線分析計：VANTA を使用した刻印アプリケーション、マイクロスキャン社製2次元コードリーダー等を展示致しましたが、混雑時には十分な説明、対応ができず、不行き届きな部分が御座いましたこと深くお詫び申し上げます。

皆様から頂戴しました貴重なご意見、ご要望をもとになお一層の努力をして参りますので、今後とも引続きご支援、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

- ・ 展示風景（開催期間：2017年6月21日～23日）

